

貸付機械器具一覧

【R1.10.1現在】

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
M100	旋盤	550
M102	帯のご盤	270
M103	小型平面研削盤	890
M105	マシニングセンター	2,080
M106	精密切断機	1,770
M107	ジグ研削盤	2,090
M108	ジグ中ぐりフライス盤	670
M111	雰囲気調整電気炉	1,770
M112	高周波誘導電気炉	1,320
M113	放電プラズマ焼結機	2,390
M114	高周波誘導式真空溶解炉	2,990
M115	粉末処理装置	140
M116	手動切断機	200
M117	試料埋込機	1,060
M118	自動研磨装置	3,200
M119	精密ワイヤ放電加工機 (B軸無使用)	2,600
M120	精密ワイヤ放電加工機 (B軸使用)	3,460
M121	高速加工機	3,060
M122	CAD/CAMシステム	690
M123	超高温電気炉	290
M124	真空含浸装置	700
M200	万能試験機	640
M201	精密万能試験機(250kN)	1,170
M203	表面性測定機	670
M204	内部欠陥判定装置	470
M205	ワックス物性試験機	180
M206	塩乾湿複合サイクル試験機装置	1,720
M207	シャルピー衝撃試験機	240
M208	高温顕微硬度計	2,420
M209	薄膜硬度計	290
M210	摩擦磨耗試験機	1,340
M211	高解像度ハイスピードカメラ	1,400
M212	表面粗さ測定装置	1,750
M213	真円度測定機	1,120
M214	CNC三次元測定機	4,380
M215	万能形状測定装置	1,000
M216	サーモグラフィ	910
M217	レーザードップラー振動計システム	610
M218	FFTアナライザ	230
M219	構造解析システム	1,700
M220	3次元湯流れ凝固解析システム	420
M222	測定顕微鏡	890
M223	万能投影機	370
M224	超微小硬さ試験機	540
M225	デジタル金属顕微鏡	610
M226	コンピュータ設計支援システム	500
M227	加工機制御用CAD/CAMシステム	790
M228	マイクロフォーカスX線CT装置	4,020
M229	非接触3次元デジタイジングシステム	3,870
M230	表面性状測定機	2,580
M231	高倍率型マイクロ스코プ	600
M232	卓上型走査電子顕微鏡	2,250
P100	サンプルカット用プロッタ	420
P101	3Dプリンタ①(材料持込)	1,080
P102	3Dプリンタ②(0.1270mm)	1,730
P103	3Dプリンタ③(0.1778mm)	2,210
P104	3Dプリンタ④(0.2540mm)	2,740

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
C100	射出成形機	1,560
C101	精密切断機(クリスタルカッター)	570
C102	精密切断機	920
C103	粉碎機(ジェットミル)	1,750
C104	マイクロカッティングマシン	540
C200	F T赤外分光光度計	2,690
C201	X線回折装置	3,320
C203	床置型精密万能試験機	660
C204	卓上型精密万能試験機	260
C205	電界放出型走査電子顕微鏡(分析)	6,980
C206	電界放出型走査電子顕微鏡(観察)	5,860
C207	エネルギー分散型蛍光X線分析装置	1,320
C208	熱分析装置	2,070
C209	X線分析顕微鏡	2,100
C211	パウダテスター	260
C212	熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	4,380
C213	レーザー回折式粒度分布測定器	1,500
C214	混練性・押出性試験装置	3,820
C215	透過型電子顕微鏡	2,210
C216	比表面積・細孔分布測定装置	770
C217	X線光電子分光分析装置	4,480
C218	イオンクロマトグラフ(陽イオン)	930
C219	イオンクロマトグラフ(陰イオン)	930
C220	イオンビームミリング装置 (電子顕微鏡用試料作成装置)	2,090
C221	高周波プラズマ発光分析装置	3,460
C222	低温プラズマ分解装置	520
C223	マイクロサンプリングマシン	960
C224	ポロシメーター	4,630
C225	マイクロ波分解装置	860
C226	誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)	2,600
C227	紫外可視分光光度計	170
C228	恒温恒湿器(旧)	150
C229	恒温恒湿器(新)	160
C230	卓上型pHメーター	450
C231	実体顕微鏡システム	170
W100	丸鋸昇降盤	170
W101	軸傾斜横挽丸鋸盤	200
W102	手押し飽盤	220
W103	自動飽盤	370
W104	定温乾燥機	270
W105	ディスクリファイナー	1,230
W106	ホットプレス	400
W107	恒温恒湿器(新)	140
J100	電磁界解析ツール	720
J104	微小部X線応力測定装置	720
J105	三次元電磁界ベクトル分布測定装置	170
J106	真空均温熱処理装置	580
J200	磁気シールドルーム	11,470
J201	ヘルムホルツコイル	320
J202	直流磁化測定装置	1,940
J203	ソレノイドコイル	490
J204	校正用機器	160
J205	ガウスメータ	250
999	その他の機械器具	100

機器番号	機 器 名	料金 (円/時間)
F101	低温恒温恒湿機	320
F102	クリーンベンチ	200
F103	真空凍結乾燥機	1,340
F104	ドラム乾燥機	880
F105	真空包装機	180
F106	低温高速遠心機	340
F107	プレハブ仕込室	180
F108	高温高圧調理殺菌装置	1,780
F111	細胞破碎装置	210
F112	微生物増殖装置	490
F117	スプレードライヤー	280
F118	高圧ホモジナイザー	360
F119	微細装置	590
F121	ホモジナイザー	160
F122	ロータリーエバポレーター	130
F200	水分活性測定装置	480
F201	測色色差計	380
F203	レオメーター	210
F206	近赤外分析装置	1,870
F207	高速液体クロマトグラフ	1,320
F208	キャピラリーガスクロマトグラフ	670
F211	自記光電分光光度計	470
F212	原子吸光分析装置	910
F213	pHメーター	210
F214	密度比重計	150
F215	蛍光プレートリーダー	1,130
F216	高速液体クロマトグラフ質量分析計	6,180
F217	マイクロファイバースコープ	890
E100	スパッタリング装置	1,960
E101	マニュアルブローバ	270
E102	マスクアライナー	680
E103	スピコーター	200
E104	真空熱処理装置	850
E200	高精度12bit型ミックスド・シグナル・オシロスコープ	270
E201	2GHz帯デジタル・オシロスコープ	260
E204	分光光度計 (電子材料分光特性評価装置)	580
E205	ソースコード静的解析ツール	340
E206	微細形状観察評価装置 (レーザー顕微鏡)	1,980
E207	制御技術開発用モデルベース設計ツール	890
E208	スペクトラム・アナライザ (U3751)	160
E209	ネットワーク・アナライザ	590
E210	風量測定器	770
E300	電波暗室	5,120
E301	雑音電界強度測定器	1,810
E302	雑音端子電圧測定器	1720
E303	雑音電力測定器	1,670
E304	ハンドヘルド型トランザイザ	240
E305	放射イミュニティ試験器	2,210
E306	伝導イミュニティ試験器	1,300
E307	静電気試験器	300
E308	商用磁界試験器	450
E309	アンテナ計測システム	1,210
E310	オシロスコープ	310
E400	ドローンテスト用ネット	1,220